

日本学術振興会「結晶加工と評価技術」第145委員会
委員総会議事次第

日時 2021年12月8日（水） 13:00～13:20
場所 Web会議

1. 議 題
1. 委員動静・幹事構成について
 2. 2021年度予算収支報告案と2022年度予算案について
 3. 2021年度の研究会企画について
 4. 2022年度ハワイシンポジウムについて
 5. 2022年度のDRIPについて
 6. 委員会の継続状況に関して
 7. その他

配付資料 1. 第9期委員名簿
2. 令和3年度決算、令和4年度予算報告

今年度予定

【定例研究会】

- (1) 第173回「ワイドギャップ半導体 Ga_2O_3 結晶成長と評価、デバイス応用の最前線」
2021年12月8日 世話人：太子、石川、上田*
- (2) 第174回「未来を切り開くイメージセンサの最前線」
2022年1月31日（月）世話人：*志村，小椋
- (3) 第175回 「先端デバイスに開発に貢献する分析・評価技術」2022年2月以降
世話人：*泉妻，佐俣，小椋
- (4) 未定

【国際シンポジウム】

第8回シリコン材料の先端科学と技術国際シンポジウム(<http://gakushin145.kir.jp/hawaii2020/>)
The 8th International Symposium on Advanced Science and Technology of Silicon Materials (2022)
実行委員長 末岡 浩治

【国際シンポジウム】

19th International Conference on Defects-Recognition, Imaging and Physics in Semiconductors (DRIP XIX)
開催日：2022年8月28日-9月1日
場所：横浜
実行委員会委員長：土田秀一，関口隆史

第145委員会のHP：<https://www.riam.kyushu-u.ac.jp/nano/gakushin145/>